

## 入射角 30° 固定正反射装置

### 固体表面の正反射分析 アライメント不要、置くだけで測定

入射角 30° 固定正反射装置は、入射角固定で取り扱いが簡単な正反射測定装置です。正反射分光分析は、光沢あるいは半光沢の試料表面層の非破壊分析、特にフィルムやコーティングの材質分析、干渉縞を利用したフィルム厚の計測、金属・ガラス表面の分析などに最適です。

試料は装置上面のアパーチャ上に下向きに設置するため、反射面が試料の厚みによらず常に一定の高さに保たれます。試料ごと、あるいは参照ミラー（標準付属）に合わせて面倒なアライメントを行う必要がありません。

付属のアパーチャ (5, 10 mm) を用いて、小さい試料の測定や試料内の範囲を絞った測定を行うことが可能です。試料は装置上面に水平に設置しますので、測定可能な最大サイズは分光器の試料室に依存します。

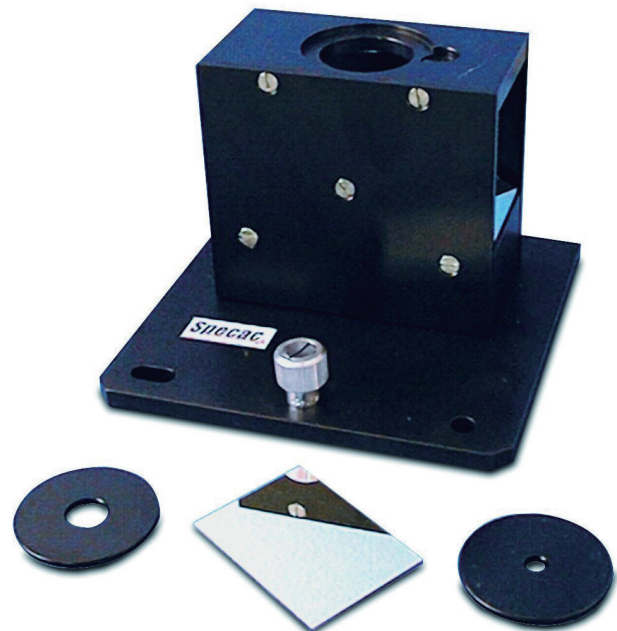
Specac 標準のベンチマークベースプレートにより、FTIR 各機種に対応します。

#### 特長

- 入射角 30° 固定
- アライメント不要のシンプルな光学系
- 試料は水平に置くだけの簡単なセッティング
- 最大アパーチャ径 20.8 mm (5, 10 mm アパーチャマスク付属)
- 粉体試料にも対応
- 分散型 IR やビーム径の大きい FT-IR にも最適

#### アプリケーション

- 表面コーティングの分析 (ポリマー・光学材等)
- 欠陥やインクルージョンの分析
- 壊れやすい試料



#### オーダー情報

##### 標準構成

##### GS19820 入射角 30° 固定正反射装置

本体光学系、ベンチマークベースプレート、参照ミラー、アパーチャマスク (5, 10 mm)

**FT-IR のメーカー名と型式をご指定ください**

※他の入射角もご相談ください。